

散乱光光弹性应力仪 SLP-2000 (518nm) 技术规格书

1. 设备名称：散乱光光弹性应力仪
 2. 设备型号：SLP-2000 (518nm)
 3. 主要技术规格：
 - 3.1 利用散乱光光弹性的原理来测量以往无法测量的锂钠离子交换的化学强化玻璃。
 - 3.2 若表面附近有钾离子层，可以与表面应力计 FSM-6000 的数据进行相结合来分析断面的应力分布。
 - 3.3 应力测量范围：0-2000MPa
 - 3.4 应力测量精度：从表面起深度 50um 以上 ± 10 MPa (标准片为基准)
 - 3.5 应力层深度测量范围：10-600um
 - 3.6 应力层深度测量精度： ± 10 um (标准片为基准)
 - 3.7 光源：LD 520 \pm 10nm 30mw Class 3B
 - 3.8 测量对象：化学强化玻璃、2 段强化玻璃、物理强化玻璃
 - 3.9 测量形状：平面-1000R 10 x 10mm 以上
 - 3.10 三棱镜折射率：1.518@518nm
 - 3.11 PC：专用 (OS、测量软件安装完成)
 - 3.12 OS：Windows10
 - 3.13 尺寸：W320*D280*H220mm (本体)
 - 3.14 重量：16kg (本体)
- 注：不要配备打印机

